

[별첨 5]

# 고출력, 고효율 광원구현을 위한 광반도체 구조설계 기술이전



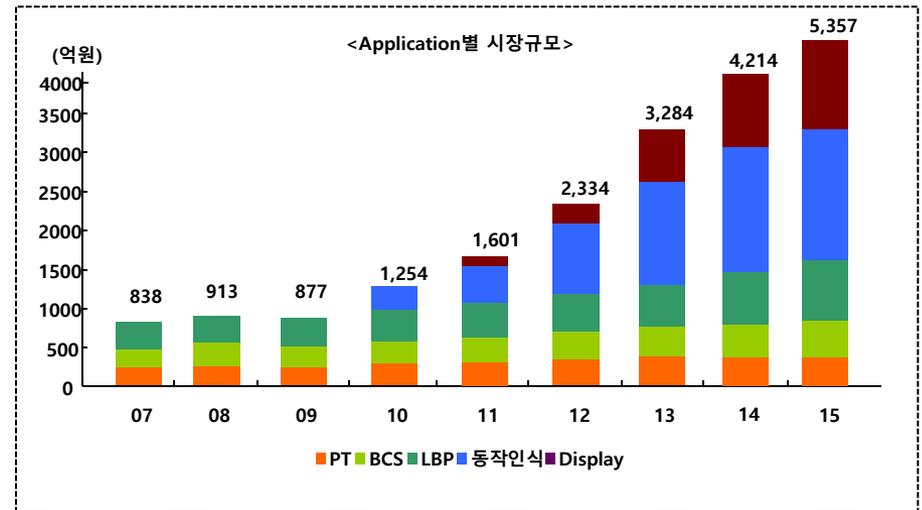
권 오 기 (okkwon@etri.re.kr)

광무선융합플랫폼연구실

(주)QSI는 GaAs 기반의 레이저 반도체 제조회사

고출력, 고효율 광원 구현을 위해 반도체 기반 구조설계 기술 필요

설계기술 획득과 미래유망기술이 접목된 기술미전



향후 스마트 보드용 850nm 광원 수요 증대 ⇒ 고풍력 광원 구조 설계 기술



## 목 차

---

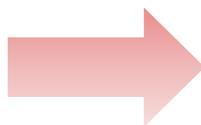
1. 기술의 개요
2. 기술이전 내용 및 범위
3. 기술의 사업성
4. 국내외 시장 동향

# . 기술의 개요: 필요기술

## ▶ 고효율, 고품질 광원구현을 위한 광반도체 구조 설계 기술

### ▣ 요구기술

- 도파로 설계 기술
  - 도파로 설계 및 분석 기술  
(단면 광자밀도 감소)
- 밴드갭 엔지니어링 기술
  - 밴드갭 최적화 기술  
(높은 광이득을 유지)
- 레이저 최적화 기술
  - Metallic thin layer
  - Non-injection section
  - 다양한 형태의 구조  
(AlGaInP 클래드)
  - 실패 분석 (FMEA)을 통한  
문제점 개선



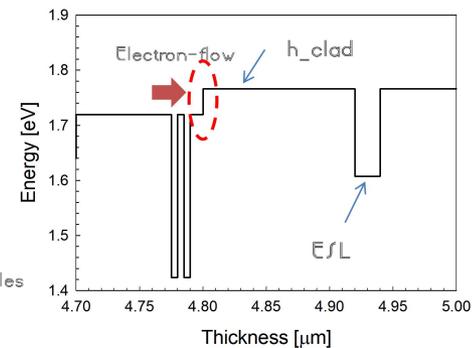
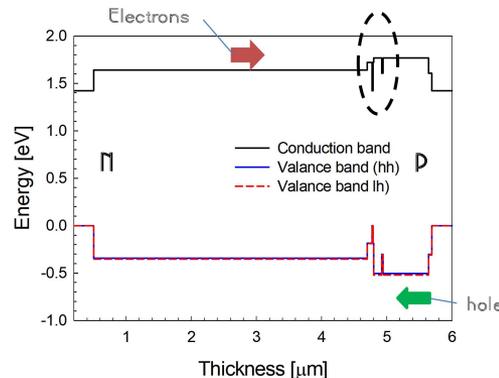
### ▣ 문제 해결

- 고효율 레이저 구현
- 향상된 COD level 구현
- 신뢰성 개선을 통한  
제작 수율 향상

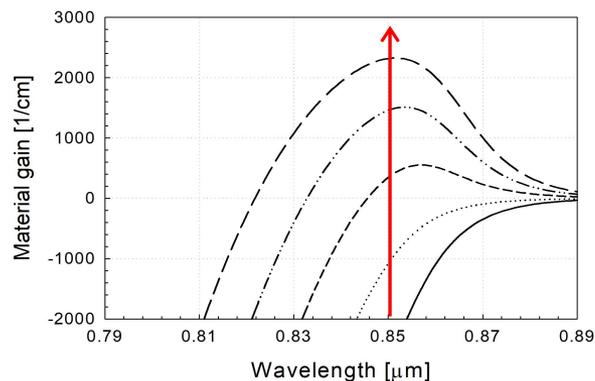
# 기술의 개요



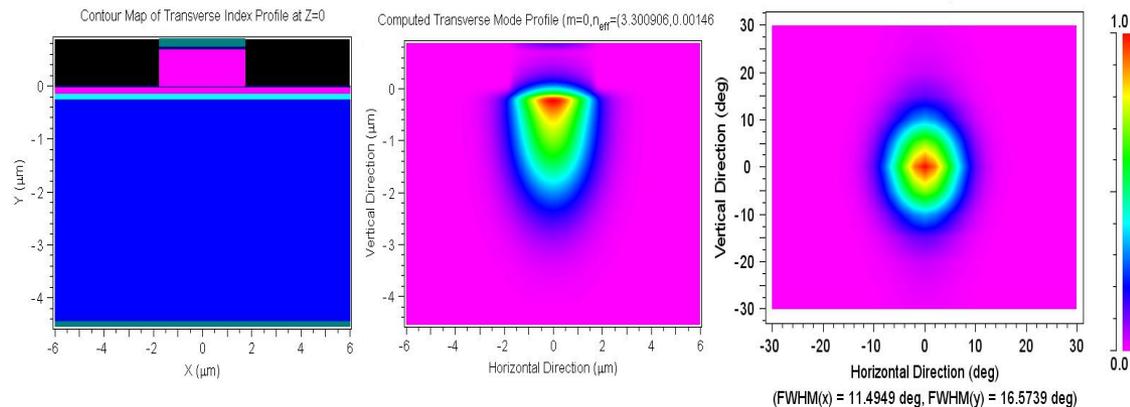
Layer	Material	x	y	f <sub>strain</sub> (ppm)	PL(nm)	Thick. (um)	Doping (cm <sup>-3</sup> )	Dopant	Strain [%]
12	p-GaAs	GaAs				0.4	2.0E+19	C	-
11	p-contact	GaIn(x)P	0.5		800±400	0.05	2.0E+18	Zn	0.12
10	p-clad	(AlxGa)In(y)P	0.60	0.5	800±400	0.7	1.5E+18	Zn	0.21
9	ESL	GaIn(x)P	0.5		800±400	0.02	1.0E+18	Zn	0.12
8	h-clad	(AlxGa)In(y)P	0.60	0.5	800±400	0.12	5.0E+17	Zn	0.21
7	p-WG	(AlxGa)As	0.35			0.01	u.d.		-
6	QW	GaAs			835	~0.004	u.d.		-
5	Barrier	(AlxGa)As	0.35			0.005	u.d.		-
4	QW	GaAs			835	~0.004	u.d.		-
3	n-WG	(AlxGa)As	0.35			0.075	u.d.		-
2	n-clad	(AlxGa)In(y)P	0.14	0.5	800±400	4.2	1.0E+18	Si	0.14
1	Buffer	GaAs				0.5	1.0E+18	Si	-



## 에피층 설계 기술



## 밴드갭 엔지니어링 기술



## 광미டு 설계/해석 기술

## 도파로 설계/해석 기술

## . 기술미전 내용 및 범위

### 850nm 에피설계 기술

적층구조 및 물질 조성 설계/분석 지원

### 밴드갭 엔지니어링 설계기술

ETRI 보유 등록프로그램(시뮬레이션 툴) 갱신 혹은 (새롭게) 제작 후 지원

### 광미투 광미투 설계/해석 기술

ETRI 보유 등록프로그램 갱신 혹은 제작 후 설계지원

### 도파로 설계/해석 기술

ETRI 보유 등록프로그램 갱신 혹은 상용 프로그램 활용 및 설계지원

### ◇ ETRI 보유 등록 프로그램

- [1] 프로그램 (관리번호: PG20020044, 접수일: 2002.04.19, 프로그램 명칭: 양자우물내 이득계산)
- [2] 프로그램 (관리번호: PG20110003, 접수일: 2011.01.04, 프로그램 명칭: 4원 물질계해석)
- [3] 프로그램 (관리번호: PG20020060, 접수일: 2002.05.24, 프로그램 명칭: 굴절을 해석)

**\* 본 구조에 적용하기 위해서는 업체에 맞는 물질계로 변경해야 함.**

# 기술이전 내용 및 범위

## 기술 개발 현황

### 기술성숙도(TRL : Technology Readiness Level) 단계 : ( 2~4 )단계

구분	단계	정의	세부 설명
기초 연구 단계	1	기초 이론/실험	기초이론 정립 단계
	2	실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념정립	기술개발 개념 정립 및 아이디어에 대한 특허 출원 단계
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본성능이 검증될 수 있는 단계 개발하려는 부품/시스템의 기본 설계도면을 확보하는 단계
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	시험생물을 제작하여 핵심성능에 대한 평가가 완료된 단계 3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하려는 단계 컴퓨터 모사가 가능한 경우 최적화를 완료하는 단계
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템 시작품 제작 및 성능 평가	확정된 소재/부품/시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능 평가가 완료된 단계 개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시작품 샘플은 1~수개 미만인 단계 경제성을 고려하지 않고 기술의 핵심성능으로만 볼 때, 실제로 판매가 될 수 있는 정도로 목표 성능을 달성한 단계
	6	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	파일럿 규모(복수 개~양산규모의 1/10정도)의 시작품 제작 및 평가가 완료된 단계 파일럿 규모 생산품에 대해 생산량, 생산용량 불량을 등 제시 파일럿 생산을 위한 대규모 투자가 동반되는 단계 생산기업이 수요기업 적용환경에 유사하게 자체 현장테스트를 실시하여 목표 성능을 만족시킨 단계 성능 평가 결과에 대해 가능하면 공인인증 기관의 성적서 확보
실용화 단계	7	신뢰성평가 및 수요기업 평가	실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 부품 및 소재개발의 경우 수요업체에서 직접 파일럿 시작품을 현장 평가(성능 및 신뢰성 평가) 가능하면 인증기관의 신뢰성 평가 결과 제출
	8	시제품 인증 및 표준화	표준화 및 인허가 취득 단계
사업화	9	사업화	본격적인 양산 및 사업화 단계 6-시그마 등 품질관리가 중요한 단계

### 3. 기술의 사업성

#### 기술의 특징

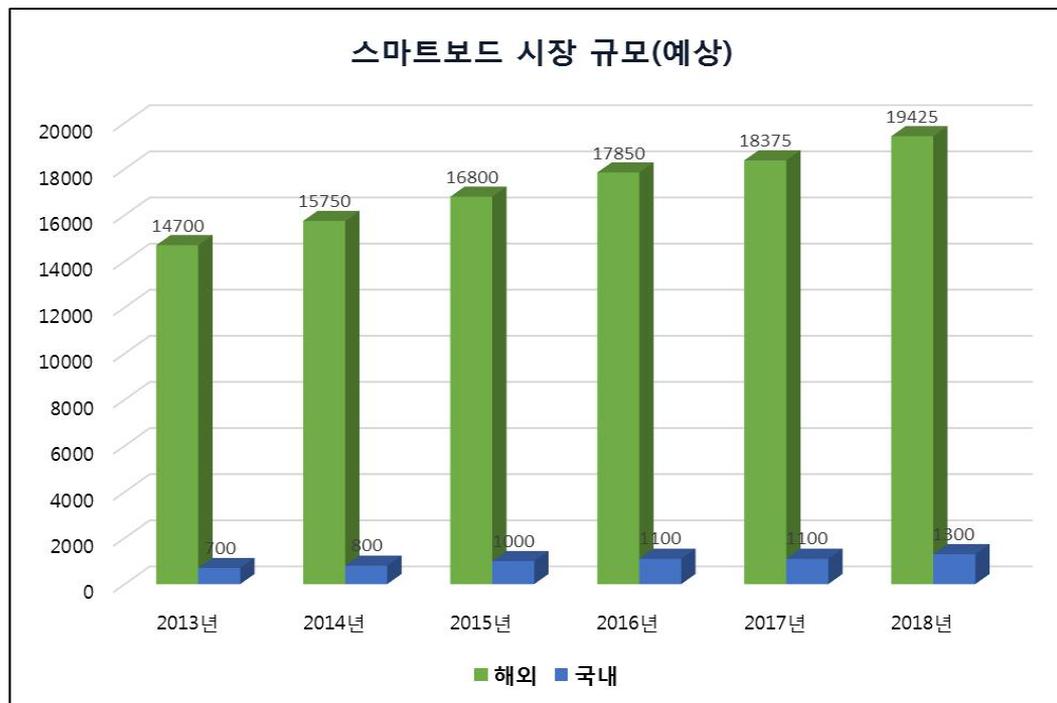
본 기술미전은 850nm 고수율, 고출력 (200mW 급) 광원 구현을 통해 기존 (동작인식용 광원) 및 신규 (스마트 보드 센서용 광원) 시장진입지원.

에트리는 InGaAsP/InP 기반의 레이저 다이오드 제작을 20여년간 진행하여 왔으며, 본 기술미전과 관련된 기술에 대한 국내 최고의 기술력을 보유하고 있어, 국가연구기관의 중소기업지원의 흐름에 적합한 기술미전.

#### 기대효과

레이저 다이오드 대량생산 설비를 완비한 QSI와 ETRI의 설계기술의 접목을 통해 신규시장 창출이 가능. (기술경쟁력과 생산경쟁력의 결합)

# . 국내외 시장 동향



## 스마트 시장 규모 예상

200mW 급의 안정적인 방사특성을 갖는 광원 개발시 시장진입 가능

감사합니다.



[www.etri.re.kr](http://www.etri.re.kr)

※ 하단의 문의처 소개후, 발표후 개별기술 상담이 가능함을 다시 한 번 안내함

♣ 연락처 : 부품소재연구부, 권오기 책·연 (042-860-1366, [okkwon@etri.re.kr](mailto:okkwon@etri.re.kr))